(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-195112 (P2001-195112A)

(43)公開日 平成13年7月19日(2001.7.19)

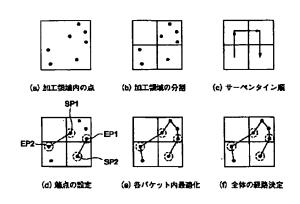
(51) Int.Cl.'		識別記号		FΙ				;	テーマコード( <del>参考</del> )
G05B	19/4093			G 0	5 B	19/4093		D	4E068
B 2 3 K	26/00			B 2	3 K	26/00		M	5B049
		3 3 0						330	5 H 2 6 9
B 2 3 Q	15/00	301		В 2	3 Q	15/00		301J	
-								301C	
			審査請求	未請求	閣	き項の数8	OL	(全 8 頁)	最終頁に続く
(21)出顧番号 特願2000-3180(P2000-3180)		(71)	出願。	人 000002	2107				
	-					住友重	機械工	業株式会社	
(22)出顧日		平成12年1月12日(2000.1	. 12)			東京都	品川区	北岛川五丁目	19番11号
				(72)	発明	者 西村	卓也		
						神奈川	県平塚	市夕陽ヶ丘6	3番30号 住友重
						機械工	業株式	会社平塚事業	<b>師内</b>
				(74)	代理	人 100071	272		
						弁理士	後藤	洋介 (ダ	1名)
				F夕	ーム	(参考) 41	9068 AF	D1 CA09 CA10	6 CB02 DA11
				ļ		51	3049 AA	04 BB07 CC2	1 EE01 EE31
							EE	41 CC07	
						51	1269 AB	11 BB05 BB0	8 CC01 GG08
							NN	16 NN17	

## (54) 【発明の名称】 レーザドリリング経路決定方法

### (57)【要約】

【課題】 経路決定に要する計算時間を短縮できるレーザドリリング経路決定方法を提供すること。

【解決手段】 あらかじめ設定されている複数の穴あけ位置情報に基づいて、レーザ光の照射位置の順序を規定する経路を巡回セールスマン問題を適用して決定する。 巡回セールスマン問題による経路決定は、レーザ光の照射位置を含む加工領域を複数のバケットに分割するステップと、分割された複数のバケットをどのような順序で巡回するかを規定する巡回路を決定するステップと、分割された各バケットにおいてレーザ光照射の始点となる始端点とレーザ光照射の終点となる終端点とを決定するステップと、分割された各バケットにおいて前記始端点と前記終端点との間のレーザ光照射位置に対して最適経路を決定するステップとを含み、あるバケットにおける終端点は、次に巡回されるべきバケットにおける始端点に結び付けられる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザ光を照射して基板に複数の穴あけ 加工を行うレーザドリリングにおいて、あらかじめ設定 されている複数の穴あけ位置情報に基づいて、レーザ光 の照射位置の順序を規定する経路を巡回セールスマン問 題を適用して決定することを特徴とするレーザドリリン グ経路決定方法。

1

【請求項2】 請求項1記載のレーザドリリング経路決 定方法において、前記巡回セールスマン問題の解法とし てシミュレーテッドアニーリング法を採用したことを特 10 徴とするレーザドリリング経路決定方法。

【請求項3】 請求項1記載のレーザドリリング経路決 定方法において、前記巡回セールスマン問題の解法とし てジェネティックアルゴリズムを採用したことを特徴と するレーザドリリング経路決定方法。

【請求項4】 請求項1記載のレーザドリリング経路決 定方法において、

前記巡回セールスマン問題による経路決定は、

すべてのレーザ光の照射位置を含む加工領域を複数のバ ケットに分割する第1のステップと、

分割された複数のバケットをどのような順序で巡回する かを規定する巡回路を決定する第2のステップと、

分割された各バケットにおいてレーザ光照射の始点とな る始端点とレーザ光照射の終点となる終端点とを決定す る第3のステップと、

分割された各バケットにおいて前記始端点と前記終端点 との間のレーザ光照射位置に対して最適経路を決定する 第4のステップとを含み、

あるバケットにおける終端点は、次に巡回されるべきバ るレーザドリリング経路決定方法。

【請求項5】 請求項4記載のレーザドリリング経路決 定方法において、

前記第1のステップにおける分割数は、あらかじめシミ ュレーションを行い、レーザ光の照射位置の数に応じて 最適な分割数が決定されることを特徴とするレーザドリ リング経路決定方法。

【請求項6】 請求項4あるいは5記載のレーザドリリ ング経路決定方法において、

タイン (serpentine) 順で行われることを特 徴とするレーザドリリング経路決定方法。

【請求項7】 請求項4~6のいずれかに記載のレーザ ドリリング経路決定方法において、

前記第3のステップにおける始端点と終端点の決定はそ れぞれ、巡回方向に関して手前側のバケットにおける終 端点との距離、巡回方向に関して先側のバケットにおけ る始端点との距離が最小になるものが選択されることを 特徴とするレーザドリリング経路決定方法。

【請求項8】 請求項4~7のいずれかに記載のレーザ 50 射する。被加工面では、レーザ光が照射された部分が蒸

ドリリング経路決定方法において、

前記第4のステップにおける最適経路の決定には、ニア リストネイバー (nearest neighbor) 法、2-opt法を適用することを特徴とするレーザド リリング経路決定方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザ光を照射し て基板に複数の穴あけ加工を行うレーザドリリングに関 し、特に複数のドリリング、すなわちレーザ光の照射を 最適な順路で行うようにするための経路決定方法に関す

#### [0002]

【従来の技術】近年の電子機器の小型化、高密度実装化 の要求に伴い、複数のプリント配線基板を重ね合わせた 多層プリント配線基板が提供されるようになってきてい る。このような多層プリント配線基板では、上下に積層 されたプリント配線基板のそれぞれに形成された導電層 間を電気的に接続するため、これらの基板に、スルーホ 20 一ルあるいはピアホールと呼ばれる穴が形成される。そ -して、これらの穴の内部に導電膜を形成することによ り、各プリント配線基板の導電層間の接続が行われる。 【0003】プリント配線基板に形成される穴は、最近 のプリント配線基板の小型化、高機能化に伴って小径化 し、直径0.1mm以下になってきている。このような 小径の穴を精度良く形成するために、パルス発振型のレ ーザ光が用いられている。

【0004】従来のパルス発振型レーザを用いたレーザ 加工装置を図11に示す。このレーザ加工装置は、パル ケットにおける始端点に結び付けられることを特徴とす 30 ス状レーザ光を発生するレーザ発振器61と、レーザ発 振器61からのレーザ光を被加工面へ導くための第1~ 第5ミラー62、63、64、65及び66と、光路上 に配置されたレンズ67、マスク68、ビームエキスパ ンダ69、ガルバノスキャナ70、及び $f\theta$ レンズ71を有している。

【0005】レーザ発振器61から出射したレーザ光 は、第1ミラー62で反射され、第2ミラー63に入射 する。第2のミラー63で反射されたレーザ光は、光路 に沿って移動可能なレンズ67を通り平行光に変換さ 前記第2のステップにおける巡回路の決定は、サーペン 40 れ、第3、第4及び第5ミラー64、65及び66で反

射され、マスク68に到達する。

【0006】マスク68には、所定径の穴が形成されて おり、その穴に照射されたレーザ光のみを通過させる。 即ち、レーザ光のビーム径を制限する。マスク68を通 過したレーザ光は、ビームエキスパンダ69で所定のビ ーム径に集光される。そして、ビームエキスパンダ69 から出射したレーザ光は、ガルバノスキャナ70で振ら れ、 $f\theta$ レンズ71に入射する。 $f\theta$ レンズ71に入射 した光は、集光され、被加工面の所定の位置に垂直に入

8/19/06, EAST Version: 2.1.0.14

3

発し、プリント配線基板に穴が形成される。

【0007】この種のレーザ加工装置では、図12に示 すように、多数の穴を一定のピッチで配列した状態で形 成する場合がある。多数の穴の形成位置はあらかじめ位 置情報として与えられており、図示しない制御装置がガ ルバノスキャナ70を制御して位置情報で規定された位 置に順にレーザ光を照射して穴あけが行われる。あるい はまた、被加工部材がX軸、Y軸に沿って可動のX-Y ステージに搭載されている場合には、このX-Yステー われる。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】ところで、穴あけ加工 は、図12に示されるような一定ピッチで配列した状態 で形成されるとは限らない。すなわち、図13に示され るように、ある加工領域内に、いわばランダムに形成さ れる場合もある。勿論、このような場合であっても、各 穴の位置情報が与えられるので、穴あけ加工そのものは 可能である。

【0009】しかし、多数の穴を加工領域にばらばらに 20 の数に応じて最適な分割数が決定される。 点在するように形成する場合、どのような順序、すなわ ち経路で穴あけ加工を行うかが加工時間を短くするうえ で重要となる。

【0010】従来の経路決定方法では、正方形のような 加工領域内にあるすべての点 (照射位置) について、1 軸ソート(各点のX座標、Y座標のうち、Y座標のみを 使ってソートする方法)を使って順番を並び替え、ソー トされた順番通りに穴あけを行っていた。これを簡略化 して示したのが図14であり、矢印に沿った順番で穴あ の移動距離が、加工領域の一辺の長さ分にもなる可能性 があり(平均では一辺の長さの半分程度)、同時にガル バノミラーの整定時間も余裕を持って設定する必要があ った。これは、加工時間が長くなることを意味する。

【0011】そこで、本発明の課題は、加工時間が短く なるようなレーザドリリング経路決定方法を提供するこ とにある。

【0012】本発明の他の課題は、経路決定に要する計 算時間を短縮できるレーザドリリング経路決定方法を提 供することにある。

# [0013]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、レーザ 光を照射して基板に複数の穴あけ加工を行うレーザドリ リングにおいて、あらかじめ設定されている複数の穴あ け位置情報に基づいて、レーザ光の照射位置の順序を規 定する経路を巡回セールスマン問題を適用して決定する ことを特徴とするレーザドリリング経路決定方法が提供 される。

【0014】前記巡回セールスマン問題の解法として は、シミュレーテッドアニーリング法を採用することが 50 うに並び替えてレーザドリリング加工実行装置12に制

できる。

【0015】前記巡回セールスマン問題の別の解法とし て、ジェネティックアルゴリズムを採用することができ

4

【0016】前記巡回セールスマン問題による最適な経 路決定、すなわち計算時間の短い経路決定は、すべての レーザ光の照射位置を含む加工領域を複数のバケットに 分割する第1のステップと、分割された複数のバケット をどのような順序で巡回するかを規定する巡回路を決定 ジの制御と合わせてレーザ光の照射位置の位置決めが行 10 する第2のステップと、分割された各バケットにおいて レーザ光照射の始点となる始端点とレーザ光照射の終点 となる終端点とを決定する第3のステップと、分割され た各バケットにおいて前記始端点と前記終端点との間の レーザ光照射位置に対して最適経路を決定する第4のス テップとを含み、あるバケットにおける終端点は、次に 巡回されるべきバケットにおける始端点に結び付けられ

> 【0017】前記第1のステップにおける分割数は、あ らかじめシミュレーションを行い、レーザ光の照射位置

【0018】前記第2のステップにおける巡回路の決定 は、サーペンタイン (serpentine) 順で行わ れる。

【0019】前記第3のステップにおける始端点と終端 点の決定はそれぞれ、巡回方向に関して手前側のバケッ トにおける終端点との距離、巡回方向に関して先側のバ ケットにおける始端点との距離が最小になるものが選択 される。

【0020】前記第4のステップにおける最適経路の決 けが行われる。しかし、この方法では1回当たりの点間 30 定には、ニアリストネイバー(nearest nei ghbor)法、2-opt法を適用する。

### [0021]

【発明の実施の形態】図1~図4を参照して、本発明の 実施の形態について説明する。 図1は、本発明を実施す るためのレーザドリリング加工装置の構成を示し、CP U10、1つの加工領域における複数の点データ(穴の 加工位置、すなわちレーザ光の照射位置データ)をファ イル形式で入力するためのファイル入力装置11、CP U10の制御下で穴あけ加工を行うレーザドリリング加 40 工実行装置12とから成る。レーザドリリング加工実行 装置12は図11で説明したような構成の加工装置であ るが、図11の構成に限定されるものではないことは勿 論である。また、CPU10はこの加工装置を制御する 制御装置で実現される。CPU10は、機能的に、レー ザドリリング経路決定部10-1と、その他のドリリン グ条件設定部10-2とに分けられる。

【0022】CPU10は、ファイル入力装置11から 与えられるドリリング地点全点のX座標およびY座標を 入力とし、穴あけの順序を工程処理時間が短縮されるよ 5

御データを渡す。

【0023】図2はCPU10による経路決定動作のフ ローチャートを示し、図3は経路決定の経過を簡略化し て示した図である。最初に、ステップS1では、CPU 10に対してファイル入力装置11から1つの加工領域 におけるドリリング地点全点のX座標およびY座標のデ ータが入力される。

【0024】 ステップS2では、はじめに1つの加工領 域を複数のバケットに細分割し(図3b)、次にバケッ トを廻る順序 (巡回路) の情報を各バケットに設定し (図3 c)、続いて各バケット内の端点を決定する(図 3d)という処理を行う。

【0025】図4は、実際の例に近い、1つの加工領域 20を9×9=81個のパケット20-1に分割した例 を示す。

【0026】加工領域を細分割する分割数は、あらかじ め加工の前にシミュレーションを行い、穴数に応じて最 適な分割数が設定される。また、バケットを廻る順序 は、あらかじめ行った実験の結果、図3(c)あるいは 図4に矢印で示すように、ドリリング地点がランダムな 20 配置の時もっとも良好な結果を示したサーペンタイン (serpentine)順を用いることにする。更 に、各バケット内の端点の決定は、各バケットにおいて ドリリングの始点となる始端点とドリリングの終点とな る終端点について行われる。特に、図3(d)に示され るように、あるパケットにおける始端点SP1と終端点 EP1の決定はそれぞれ、巡回方向に関して手前側のバ ケットにおける終端点EP2との距離、巡回方向に関し て先側のバケットにおける始端点SP2との距離が最小 になるものが選択される。

【0027】上記のステップS2に続いてステップS3 の処理が実行される。ステップS3は、分割された各バ ケット毎に始端点と終端点との間のドリリング点に対し て最適経路を決定するための処理である(図3e参 照)。ステップS3では、ステップS2での加工領域分 割処理により、各バケットのドリリング点の平均個数は 元の加工領域内のドリリング点の個数より大きく減少し ている。ここでは、初期設定時のドリリング位置訪問順 序をもとに、移動距離が最短になるように改善する。こ の問題は、巡回セールスマン問題(元の位置に戻る必要 40~06:xの近傍解 $x^-=N(x)$ をランダムに選ぶ が無く、端点を固定しているタイプ)である。改善法と しては、計算速度が速く誤差の小さい方法として、巡回 セールスマン問題のヒューリスティクスとして知られる ニアリストネイバー (nearest neighbo r)法と2-opt法を適用した。

【0028】図5は、ニアリストネイバー法と2-op t法とによる改善の経過を示した図である。

【0029】ステップS3の処理に続いてステップS4 が実行される。ステップS4は、あるバケットにおける 終端点を、次に巡回されるべきバケットにおける始端点 50 12:終り

に結び付けることで加工領域全体の経路を決定する処理 である(図3f参照)。すなわち、ステップS2で定め られた各バケットの終端点の次に訪問するドリリング点 を、ステップS2で定められたバケットを廻る順序に従 って決定していくだけの処理である。

【0030】以上の処理により、CPU10における計 算時間を最短にし、かつ加工時間を最短にする最適な経 路を決定することができる。

【0031】図6は~図8はシミュレーションの例を示 10 し、図6は加工領域に設定されたドリリング点を示す。 図7は、図6のドリリング点に対し、従来の1軸ソート による方法でドリリング経路を設定した場合の例を示 し、図8は、本発明の手法によりドリリング経路を設定 した場合の例を示す。

【0032】図9は、本発明の第1の変形例として巡回 セールスマン問題の解法にシミュレーテッドアニーリン グ法を採用した場合のドリリング経路を示す。シミュレ ーテッドアニーリング法というのは、高温の溶融状態に ある物質に対し温度を徐々に冷却することにより、エネ ルギー的に安定した結晶構造が生成される物理現象に着 目し、これをシミュレーションすることによって局所最 適解が多数存在する多峰性関数の最適化問題や、組合わ せ最適化問題を解く方法として提案された手法であり、 例えば「電子情報通信学会論文誌」、Vo١. J81-A、No. 12、1783~1791頁(1998年、 12月)に、「巡回セールスマン問題に対する効率的な 混合型遺伝的アルゴリズムの一検討」(以下、第1の文 献と呼ぶ)と題して開示されており、あるいはまた「計 測自動制御学会論文集」、第31巻、第5号、598~ 30 605頁 (1995年5月) に、「遺伝アルゴリズムに よる巡回セールスマン問題の一解法」(以下、第2の文 献と呼ぶ)と題してに開示されている。

【0033】シミュレーテッドアニーリング法は、簡単 に言えば、以下の手順により実行される。

【0034】01:開始

02:パラメータの設定

03:任意の初期解x(ある経路のこと)を設定

04:ここからループ作業(04から10まで)

05:指定回数繰返し(05から8まで)

07:xの経路長とx<sup>1</sup>の経路長とを比較して、

08:解経路の更新作業

もし経路xの経路長よりx<sup>-</sup>の経路長の方が短いなら、 解xをxで更新

そうでなくても(経路長が長くなるとしても)ある確率 で解xをx゚で更新する

09:パラメータの更新

10:ループ脱出条件

11:解の出力

8/19/06, EAST Version: 2.1.0.14

上記の手順において、パラメータの設定は、シミュレー ションにより下準備をして、良好な解が出るように設定 した。解xの初期値としては、乱数によりランダムに設 定した。繰返し回数も穴数の定数倍になるようにする が、その定数はシミュレーションにより下準備し設定し た。近傍解N(x)の決定法としては、2-opt法に より経路の一部を交換した(2-opt法において経路 長が短くならない交換だとしてもとりあえず交換す る)。ある確率というのは、Metropolisの方 法(上記の第2の文献参照)を用いた。

【0035】図10は、第2の変形例として巡回セール スマン問題の解法にジェネティックアルゴリズムを採用 した場合のドリリング経路を示す。ジェネティックアル ゴリズムというのは、自然界における生物進化のモデ ル、すなわち世代を形成している個体の集合(個体群) の中で、環境への適応度の高い個体が次世代により多く 生き残り(選択)、また交叉及び突然変異を起こしなが ら次の世代を形成していく過程を用いた最適化方法であ り、これも上記の第1及び第2の文献に開示されてい

【0036】図9、図10の例では、図8の例に比べて 経路の計算時間は長くなるが、ドリリング点間の距離は 図7の従来例に比べて短くできるので、ガルバノミラー の整定時間に関する問題を解消でき、従来法に比べて加 工時間の短縮を実現できる効果が得られる。

【0037】以上、本発明の実施の形態を、プリント配 線基板に穴あけを行う加工装置に適用して説明したが、 加工対象はプリント配線基板に制限されるものではな い。また、レーザ加工装置の構成も図11に示されたよ うな構成に限定されるものではなく、レーザにより多数 30 のシミュレーション例を示した図である。 の穴あけを行う装置全般に適用できる。

[0038]

【発明の効果】本発明によれば、以下の効果が得られ

【0039】(1)工程時間の短縮

現行の1軸ソートのみの方法に比べて、移動距離を大幅 に改善できる。それに伴い、ガルバノミラーの整定時間 にもよるが、移動にかかる時間を大幅に改善できる。そ の結果、レーザドリリング加工の工程時間が短縮され、 生産の効率が上がる。

【0040】(2)高速なCPU計算時間

レーザドリリング位置訪問順序決定問題は、巡回セール スマン問題の典型例であるといえるが、よく知られてい る準最適化法では、効率的なものでも、平均200穴程 度の領域が120個程度あれば、CPU計算時間がかか りすぎる。しかし、本発明では、加工領域の分割と高速 で知られる準最適化法を巧みに用いて、極めて短い計算 時間でドリリング位置訪問順序決定を行うことができ

【0041】(3)ガルバノミラーの整定時間の短縮 本発明による訪問順序改善により、ドリリング位置から 次のドリリング位置までの距離の最小値が改善されてい る。ガルバノミラーの整定時間は移動距離の増加に対し 単調増加であるので、1移動の最大距離により整定時間 を決定すれば、整定時間を短縮することができる。

【図面の簡単な説明】

10 【図1】本発明が適用されるレーザ加工装置の概略構成 を示したブロック図である。

【図2】図1のCPUによる経路決定動作を説明するた めのフローチャートである。

【図3】図2の経路決定動作を、加工領域を簡略化して 説明するための図である。

【図4】加工領域を複数のバケットに分割した例及び各 バケットの巡回路の例を示した図である。

【図5】1つのバケット内での最適経路決定におけるニ アリストネイバー法と2-opt法とによる改善の経過 20 を示した図である。

【図6】加工領域に設定された多数のドリリング点のシ ミュレーション例を示した図である。

【図7】図6の例に適用された従来法によるドリリング 経路のシミュレーション例を示した図である。

【図8】図6の例に適用された本発明によるドリリング 経路のシミュレーション例を示した図である。

【図9】本発明の第1の変形例によるドリリング経路の シミュレーション例を示した図である。

【図10】本発明の第2の変形例によるドリリング経路

【図11】レーザ加工装置の一例の構成を示した図であ

【図12】プリント配線基板に形成される多数の穴の配 列の一例を示した図である。

【図13】プリント配線基板にランダムに形成される多 数の穴の配列の一例を示した図である。

【図14】従来法によるドリリング経路の一例を簡略化 して示した図である。

【符号の説明】

レーザ発振器 40 61

62~66 第1~第5ミラー

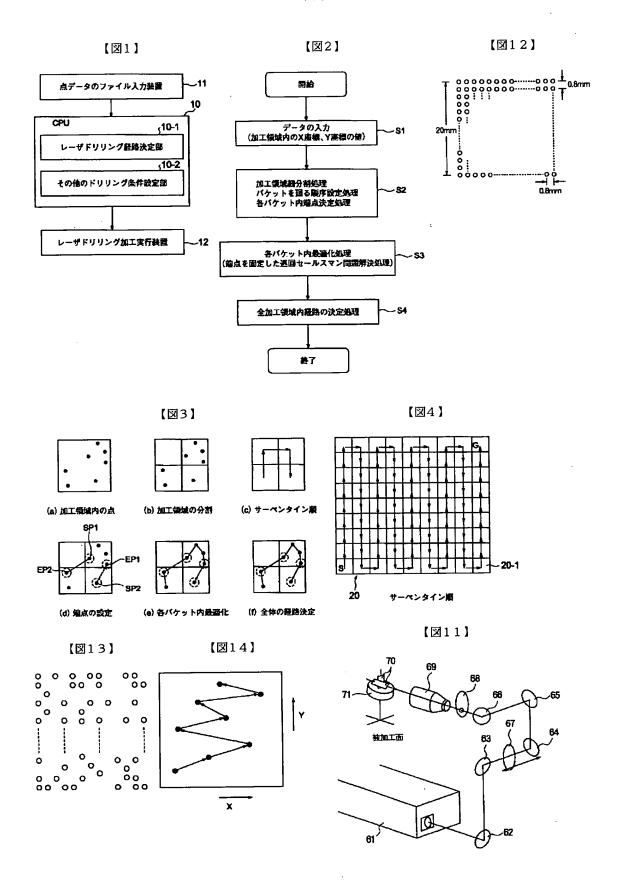
67 レンズ

68 マスク

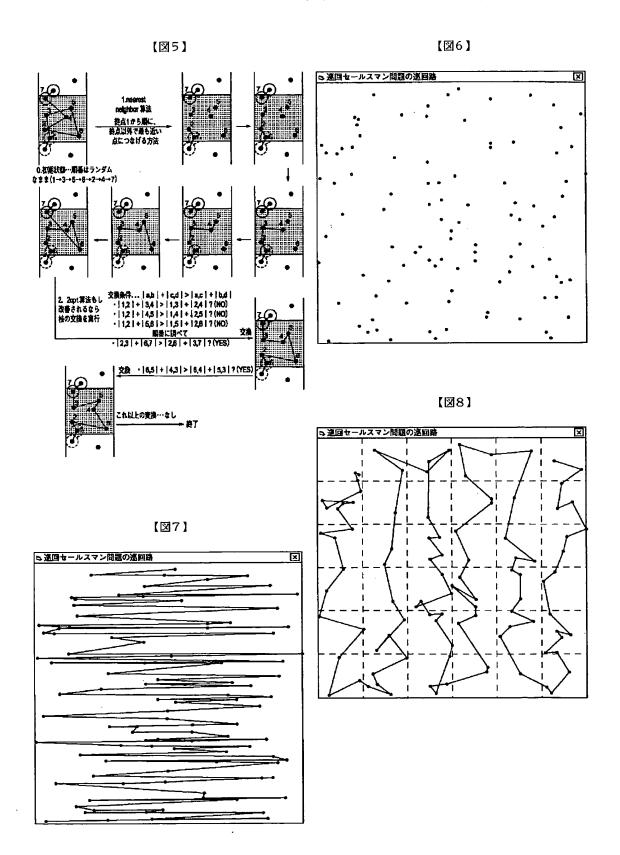
69 ビームエキスパンダ

70 ガルバノスキャナ

71 fθレンズ

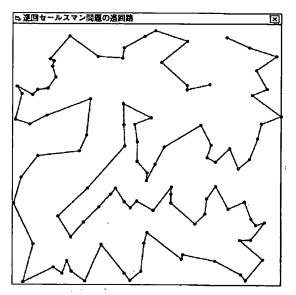


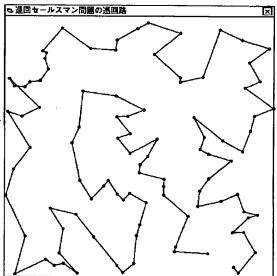
8/19/06, EAST Version: 2.1.0.14



【図9】

【図10】





フロントページの続き

(51) Int. Cl . <sup>7</sup>	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
B 2 3 Q 15/00	303	B 2 3 Q 15/00	303Z
G06F 17/60		B 2 3 K 101:42	
// B23K 101:42		G O 6 F 15/21	R